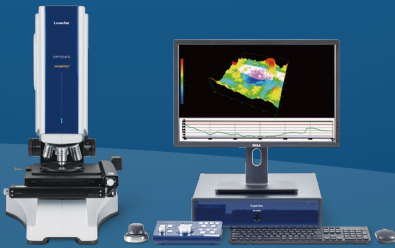


ハイブリッドレーザーマイクロスコープ

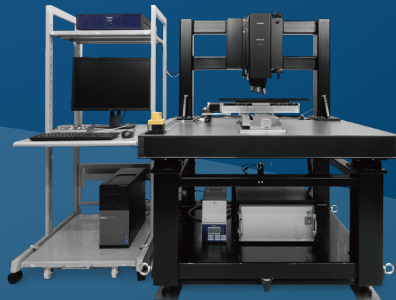
OPTELICS HYBRID⁺

開発・量産フェーズに応じたカスタマイズ



レーザー顕微鏡 OPTELICS HYBRID⁺

R&D



特殊ステージ仕様

量産試作



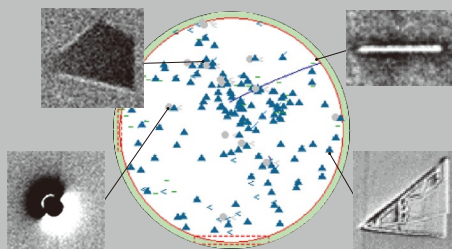
SiCウェハ欠陥検査/レビュー装置 SICA88
GaNウェハ欠陥検査/レビュー装置 GALOIS211

量産ライン

R&D用途から抜き取り検査といった量産試作、さらに全数検査の用途にいたる各プロセスで、検査・計測ニーズに合わせたカスタム対応が可能です。

計測事例

化合物半導体ウェハ検査



欠陥形状の計測

幅:65 μ m 深さ:10nm

